

Title (en)  
DEVICE FOR PUNCHING A CONVEYED FLAT ELEMENT

Title (de)  
VORRICHTUNG ZUM STANZEN EINES GEFÖRDERTEN FLÄCHENELEMENTES

Title (fr)  
DISPOSITIF POUR POINÇONNER UN ÉLÉMENT DE SURFACE TRANSPORTÉ

Publication  
**EP 4275850 A1 20231115 (DE)**

Application  
**EP 23172010 A 20230508**

Priority  
DE 102022111895 A 20220512

Abstract (de)  
Bei einer Vorrichtung zum Stanzen eines geförderten Flächenelementes, insbesondere zum Stanzen eines Bandes mit insbesondere durch Tiefziehen in diesem Band eingeformten Behältern, umfassend wenigstens ein Stanzoberwerkzeug und umfassend zumindest ein Stanzunterwerkzeug, die zum Ausführen der Stanzung gegeneinander bewegbar sind, ist vorgesehen, dass zumindest eine Bewegungseinrichtung für ein Stanzwerkzeug zumindest eine etwa quer zur Förderrichtung des Flächenelementes und quer zur Bewegungsrichtung des Stanzwerkzeuges liegende Kurbelwelle hat, an der Pleuelelemente angelenkt sind, deren von der Kurbelwelle abgewandte Enden an dem Stanzwerkzeug angelenkt sind. Eine Vorrichtung der eingangs genannten Gattung ermöglicht ein Stanzen mit hohen Kräften ohne das Auftreten von Biegungen in den beteiligten Werkzeugen.

IPC 8 full level  
**B26F 1/40** (2006.01); **B26D 5/14** (2006.01); **B26D 7/26** (2006.01); **B26F 1/44** (2006.01); **B65B 61/06** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B26D 5/14** (2013.01); **B26D 7/2628** (2013.01); **B26F 1/40** (2013.01); **B26F 1/44** (2013.01); **B65B 9/04** (2013.01); **B65B 61/065** (2013.01); **B65B 61/08** (2013.01); **B65B 65/04** (2013.01); **B26F 2001/4436** (2013.01)

Citation (applicant)  
DE 102015211622 A1 20161229 - MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER SE & CO KG [DE]

Citation (search report)  
• [XAY] CN 113044329 A 20210629 - ZHENGZHOU WIPES MACHINERY EQUIPMENT CO LTD  
• [XY] CN 112518887 A 20210319 - CHEN YOUNG  
• [Y] CH 401659 A 19651031 - GILLETTE FRANCE S A [FR]

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA

Designated validation state (EPC)  
KH MA MD TN

DOCDB simple family (publication)  
**EP 4275850 A1 20231115**; DE 102022111895 A1 20231116

DOCDB simple family (application)  
**EP 23172010 A 20230508**; DE 102022111895 A 20220512